

先端的研究機器導入・管理制度について

【概要】

本制度は、最先端の共用化機器を早期導入したい時や、不意の保守・修理が発生した時に、その予算を学術研究・産学官連携推進機構が一時的に立替え、後年次の申請者予算から返済する仕組みです。

【条件・手順】

1. 経費の執行が当年度中に可能である。
2. 部局（予算配分部局）から後年次返済の保証が得られる。
3. 会計手続き上の支障がない。

手順1 [受付シート](#)の記載・提出（随時受付）

手順2 対象機器の選定・決定・通知（12月頃）

手順3 利用申請書作成・提出

手順4 対象機器の購入・保守・修理（年度内）

手順5 返済開始（翌年度以降）

【お問い合わせ・提出先】

基盤研究支援センターコアファシリティ推進室
email: cf-shinshu@shinshu-u.ac.jp